

角型Ptfеウェーハ洗淨バスケット フッ素樹脂製半導体エッチングラック

カスタムシリコンウェーハキャリア

商品番号: PL-CP89



前書き

カスタム角型PTFEウェーハ洗淨バスケットで半導体ウェットベンチプロセスを最適化してください。優れた耐薬品性と高純度ハンドリングのために設計されたこれらのフッ素樹脂製キャリアは、重要なシリコンウェーハのエッチングと洗淨において優れた耐久性と精度を提供します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主なメリット
シリコンウェーハエッチング	表面層の除去や特定のテクスチャ形成のため、基板を酸性エッチング液に浸漬する処理。	HFと硝酸の混合液に対して優れた耐性を発揮。
太陽電池洗淨	ドーピングやコーティング前に、大判角型太陽光発電ウェーハを多段階洗淨する処理。	大量処理に対応し、破損を最小限に抑えます。
MEMS処理	重要な化学リリース工程中に微小電気機械システムをハンドリングする処理。	高純度環境が微小汚染を防止します。
超音波洗淨	精密光学部品や電子部品からサブミクロン粒子を除去するために超音波槽内で使用する処理。	制振特性によりデリケートな部品を振動損傷から保護します。
微量元素分析	分析化学のために高純度酸槽内で実験器具の調製・洗淨を行う処理。	PPBレベルの検出においてバックグラウンド干渉を最小限に抑えます。
LED基板ハンドリング	サファイアまたは炭化ケイ素ウェーハを強力な洗淨・リンス工程を通して支持する処理。	高温化学プロセスにおいて長期的な信頼性を発揮します。
薬品保管・輸送	クリーンルームモジュール間の輸送中に敏感な基板を安全に収容する処理。	非反応性表面がウェーハ表面の化学的性質を保護します。
研究室研究	大学や研究開発ラボで実験用材料を処理するためのカスタムサイズキャリア。	適応可能な設計で非標準の実験装置にも対応できます。

仕様カテゴリ	PL-CP89のパラメータ詳細
モデル識別	PL-CP89
標準寸法	249mm x 249mm (角型構成)
素材構成	100% 高純度PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
薬品適合性	万能 (熔融アルカリ金属および元素状フッ素を除く)
温度範囲	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)
製造方法	固体ビレットからの完全CNC加工
ウェーハ収容数	完全カスタマイズ可能 (可変スロット数・ピッチ)
スロット幅	精密加工 (ウェーハの厚さに合わせてカスタマイズ可能)
排水機能	流体交換のためのベースおよび側面一体型流路穴

仕様カテゴリ	PL-CP89のパラメータ詳細
ハンドルオプション	オプションで着脱式または一体型PTFEハンドルを利用可能
表面仕上げ	粒子のトラップを防止する滑らかで非多孔質の加工仕上げ
準拠性	RoHS準拠、FDAグレード原材料